## C-Band TM モード Nb 空洞

高エネルギー研,東北大核理研<sup>a)</sup> 細山謙二,諫川秀,木村嘉孝,小島融三,今野収<sup>a)</sup> 序 6.5 G H3 Nb単空洞、TM010モードの超伝導状態に於る高周波特性について調べた。 超伝導空洞のQ値は空洞の表面の状態に非常に敏感である。そこで今回は5個のNbの単空洞を用いて 2) 電解研摩,化学研摩,超高真空炉による熱処理等によりQ値がどのように変化するかを調べた。

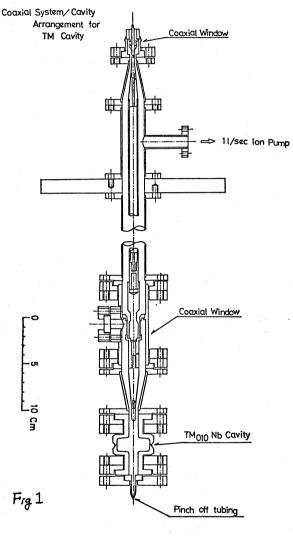


Fig 1

Pinch off tubing

Hmax = 264 (

Fig 2

Pinch off tubing

Hmax = 264 (

Att. Circulator

Pin TWT

Phase Shifter

Phase Shifter

Frequency Synthesizer

Frequency Synthesizer

Frequency Control Voltage

Phase Scope Att. Scope Differential Amp. Pin Pe

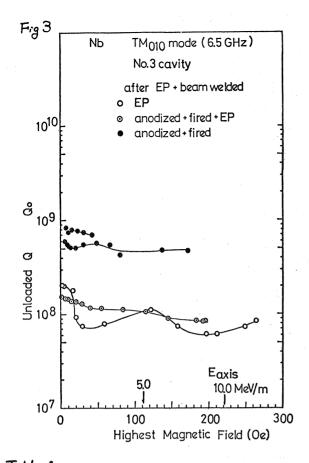
Experimental Setup

実験装置 Fig1に空洞ハマイクロ波を供給する同軸マイクロ波回路を示す。空洞の真空はセラミック製の同軸窓によりマイクロ波回路の真空と区切られている。この部分はリープション・ポンプ、イオンポンプにより 10<sup>-8</sup> torr以下に排気した後、ピンチ・オフする。マイクロ波結合用Nbプローブの長さは固定である。

測定 空洞は半割ずっNb村から機械加工により削り出し、電解研摩により約60μm表面を研摩し、不純物、機械的歪等を取り除いた後電子だっム熔接により接合し、色々な表面処理を行なった。Q値の測定はFig 2 の装置を用いて行なった。

結果 Fig 3にNo.3空洞に対して色々な表面
処理を行なった場合の 1.3°Kに於る Qo(umloaded
Q)値の入射パワーPi 依存性を示す。Piと空洞
内の最高磁場Hmax [Oe],中心軸上の電場の平均
の強さ Eaxis [MV/m]の関係はでいかする"LALA"
で求めた。○は電子ビーム熔接の後、電解研摩を行った場合で、Pi を上げてもQo値はあまり下がらず
Hmax = 264 Oe, Eaxis = 12 M/m で Qo ~ 108 であ

る。 ©で anodige L た後, 超髙 真空炉で 10<sup>-6</sup>torr, 1600℃, 3 時 陶熱処理後, 電解研摩した場合を、 その後 anodige , 1600℃, 10 時间 の場合を●で示す。 Fig 4 に温 度変化による表面抵抗尺の変化の 様子を示す。 Table 1 に空洞・ NO.2, NO.3 の測定結果を示す。ここで Hmax の\* Ep はをこで multipactoring が起こったことや、 Qo



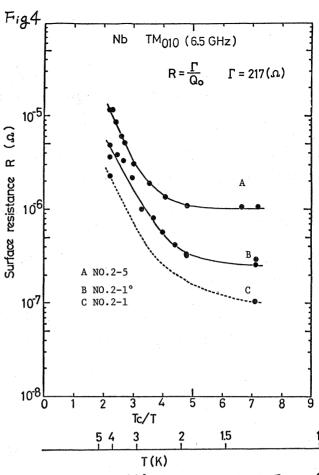


Table 1 Results of C-Band Nb  ${
m TM}_{010}$  Cavity at 1.3° K

Test	NO. Q	0 at Low Power	$Q_{\mathbf{x}}$	H <sub>max</sub> (O	e)	Q <sub>0</sub> at	H max	Surface Treatment	
NO. 2	Cavit	У				,			
	1 2.1	x 10 <sup>9</sup>	$(4.0 \times 10^9)$	> 24	2.5	x 10 <sup>8</sup>	EP (6	0)+BW+CP	
	ı° 5.0	x 10 <sup>8</sup>	$(4.2 \times 10^9)$	>35	6.4	x 10 <sup>7</sup>			
	2 1.7	x 10 <sup>8</sup>	$(7.2 \times 10^8)$	very	low		CP CP		
	3 4.5	$\times$ 10 <sup>7</sup>	$(8.4 \times 10^7)$	>30	2.7	x 10 <sup>7</sup>	EP (2	)	
	4 2.3	x 10 <sup>8</sup>	$(4.3 \times 10^8)$	115*	9.3	x 10 <sup>7</sup>	EP (6	)	
	4° 2.2	x 10 <sup>8</sup>	$(3.5 \times 10^8)$	195*	8.3	x 10 <sup>7</sup>			
	5 3.7	x 10 <sup>8</sup>	$(3.1 \times 10^8)$	27*	3.3	x 10 <sup>8</sup>	EP (6	)	
NO. 3	Cavity	7							
	1 1.5	x 10 <sup>8</sup>	$(2.8 \times 10^7)$	>57	2.4	x 10 <sup>7</sup>	EP (6	0)+BW+EP(6)	
	2 1.9	x 10 <sup>8</sup>	$(2.0 \times 10^8)$	>264	8.2	х 10 <sup>7</sup>	EP (1	0)	
	3 8.1	x 10 <sup>7</sup>	Super Leal	k!			anod	anodized+fire (1600°C,3h) EP(6)	
	4 1.5	x 10 <sup>8</sup>	$(1.3 \times 10^8)$	196*	8.2	x 10 <sup>7</sup>	EP (6		
. !	5 8.3	x 10 <sup>8</sup>	$(1.5 \times 10^9)$	42*	6.9	х 10 <sup>8</sup>	anod	anodized+fire (1600°C,10h)	
. !	5 5.9	x 10 <sup>8</sup>	$(1.4 \times 10^9)$	>175	4.8	х 10 <sup>8</sup>			

が突然下がったことを示す。(印のないものは何も起らない。)

## 「 参考文献`」

- 1 Yuzo Kojima KEK-75-2 (1975),55
- 2 P. Kneisel et al. National Particle Accelerator Conference (1975)
- 3 H.C. Hoyt, et al. The Review of Scientific Instruments (1966) 755

CP : Chemically Polished

EP : Electropolished

BW : Electron Beam Welded